# **FOCUS DETECTOR**

Publication number: JP1080920 Publication date: 1989-03-27

Inventor:

UTAGAWA TAKESHI; KUSAKA YOSUKE; UCHIYAMA

SHIGEYUKI; YAMANO SHOZO; ISHIZUKI KENJI; HASEGAWA HIROSHI; OGASAWARA AKIRA

Applicant:

NIPPON KOGAKU KK

Classification:

- international:

G03B13/36; G02B7/34; G03B3/00; G03B13/36;

G02B7/34; G03B3/00; (IPC1-7): G02B7/11; G03B3/00

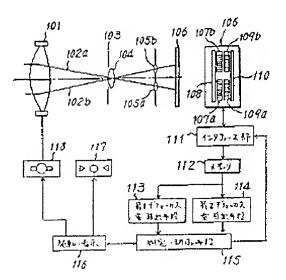
- European:

Application number: JP19870238227 19870922 Priority number(s): JP19870238227 19870922

Report a data error here

# Abstract of JP1080920

PURPOSE:To improve response and lowbrightness limit performance by providing 1st and 2nd photoelectric element array parts which have small sample pitch and 3rd and 4th photoelectric element array parts which have large sample pitch. CONSTITUTION: This device is provided with the 1st and 2nd photoelectric element array parts 107a and 107b for the photoelectric output of a photoelectric element array part 106 which have the small sample pitch and the 3rd and 4th photoelectric element array parts 109a and 109b which have the sample pitch larger than the 1st and 2nd photoelectric element array parts 107a and 107b. The photoelectric outputs of the photoelectric element array parts 107a and 107b are used to detect a fine pattern and perform focus detection with high accuracy and the photoelectric outputs of the photoelectric element array parts 109a and 109b are used to perform focus detection for a body with fast response and low-brightness limits. Consequently, the focus detection accuracy is improved and the response and low-brightness limit performance are improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list

2 family member for: JP1080920

Derived from 1 application

Back to JP108

**FOCUS DETECTOR** 

Inventor: UTAGAWA TAKESHI; KUSAKA YOSUKE; Applicant: NIPPON KOGAKU KK

(+5)

**IPC:** G03B13/36; G02B7/34; G03B3/00 (+5) EC:

Publication info: JP1080920 A - 1989-03-27 JP2535954B2 B2 - 1996-09-18

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

10 特許出願公開

#### 四公開特許公報(A) 昭64-80920

(1) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989) 3月27日

G 02 B G 03 B 7/11 3/00 C-7403-2H A-7403-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全13頁)

焦点検出装置 63発明の名称

> 願 昭62-238227 创特

> > 儲

頤 昭62(1987)9月22日 ②出

Ш 79発 明 者 歌

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会 社大井製作所内

下 洋 介 73発 明者  $\boldsymbol{\mathsf{B}}$ 

日本光学工業株式会 東京都品川区西大井1丁目6番3号 社大井製作所内

⑦発 明 者 重 之 内 Ш

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会 社大井製作所内

省  $\equiv$ 73発 明 者 野

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

①出 願 人 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

弁理士 渡辺 隆男 の代 理 人 最終頁に続く

1. 発明の名称

- 焦点校出装置 2. 特許請求の範囲
- (1) 第一及び第二光電素子アレイ部からの同一サ ンプルピッチの出力を用いて、第一焦点検出出力 を発生する第一デフォーカス量検出手段と、

第三及び第四光電素子アレイ部からの同一サン プルピッチの出力を用いて、第二焦点検出出力を 発生する第二デフォーカス量検出手段と、

前記第一及び第二光電索子アレイ部のサンブル ピッチを、前記第三及び第四光電素子アレイ部の サンプルピッチより小さくしたことを特徴とする 焦点検出装置。

(2) 前記第三及び第四光電素子アレイ部の実効的 な部分の長さを、前記第一及び第二光電素子アレ イ部の実効的な長さより大きくしたことを特徴と する焦点検出装置。

(3) 前記第一光電素子アレイ部と前記第三光電素 子アレイ部とを並列し、前記第二光電素子アレイ

部と物記第四光質素子アレイ部とを並列する構成 をとり、何れか一方の並列する前記光電索子アレ イ部の間に物体の照度を検出するためのモニター センサー部を有することを特徴とする特許請求の 範囲(1)項記載の焦点検出装置。

(4) 前記第一光電素子アレイ部と前記第三光電素 子アレイ部とを並列し、前記第二光電素子アレイ 部と前記第四光電素子アレイ部とを並列する構成 をとり、何れか一方の並列する前記光質素子アレ イ態の間に物体の色温度をモニターする色温度モ ニター手段を有することを特徴とする特許請求の 範囲第(1)項記載の焦点検出装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、焦点検出装置に関するものである。 (従来の技術)

第13図の焦点検出装置は、カメラに適用され た構成例を示している。カメラの撮影レンズ系1 01を通った被写体光は、視野紋り103及び フィールドレンズ104及び一対の再結像レンズ

105 \* 105 bを通って、一対の電荷蓄積型 光電素子アレイ106a、106bの形成された 焦点検出基板106に結像される。焦点検出基板 106に形成された一対の光電素子アレイ106 a. 106 bは、結像された被写体光像に対応す る光電出力を発生し、この光電出力をA/D変換 部10によりデジタル値に変換してメモリ部11 に記憶し、デフォーカス量算出手段12によりこ の記憶されたデジタル値に基づき摄影レンズ系! 01の合焦点までのズレ量を貸出し、駆動表示部 13により算出されたズレ量に基づき焦点調節状 態を表示部14で行うと共にモータ15により提 影レンズ系101を合焦点に向けて駆動する。

#### (発明の解決しようとする問題点)

上記の如き焦点検出装置の光電素子アレイ10 6 a , 1 0 6 b は、複数の光電素子が所定の画素 ピッチョを有して配列されて構成されているので、 画索ピッチャを小さくするとより微細なパターン の被写体も検出が可能となる反面、焦点検出に必 要な所定の情報を得るのに必要な電荷蓄積時間が

# (実施例)

# ~ 第一実施例 ~

第1図~第4図は、本発明の第一実施例であり、 第1回はカメラに適用した焦点検出装置の概念図、 第2図は前記焦点検出装置の第一及び第二デフ ォーカス置算出手段の出力タイミングを示すタイ ミングチャート図、第3図は前記焦点検出装置の フローチャート図、第4図は前記魚点検出装置の 107と109との間はなるべく狭く配置され、 焦点検出基板の構成図を示す。

第1図において、焦点検出用の光学系101~ 105は、第13図の光学系と同様な構成である。 焦点検出基板106は、菌素ピッチの小さいの一 対の光電索子アレイ107 (第一光電素子アレイ 部107a及び第二光電素子アレイ部107b) と、ほぼこれに並列したピッチの大きいの一対の 光電素子アレイ109(第三光電素子アレイ郎1 09a及び第四光電素子アレイ部109b)とが 形成されると共に、それぞれ外側に、第一及び第 二光電素子アレイ部107a、107b用のシフ トレジスター部108と、第三及び第四光電索子

増大し、応答性が悪くなると共に検出可能な低輝 度限界が上昇してしまうと言う欠点がある。

本発明は、微細なパターンを有する物体も検出 可能であると共に、焦点検出特度が高く且つ応答 性、低輝度限界性能も向上させた焦点検出装置を 提供することを目的とする。

#### (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決する為に、本発明の焦点検出 装置では、光電素子アレイ部の光電出力に関する サンプルピッチの小さい第一及び第二光電素子で レイ部と、第一及び第二光電索子アレイ部のサン プルピッチより大きいサンブルピッチを有する第 三及び第四光電素子アレイ部とを設けた。

#### (作用)

本発明では、サンブルピッチの小さい光質宏子 アレイ部の光電出力を用いて、微細パターンの検 出及び高精度の焦点検出を行い、サンプルピッチ の大きい光電素子アレイ部の光電出力を用いて高 速応答性及び低輝度限界の低い物体の焦点検出が できるようになる。

アレイ郎109a.109b用のシフトレジス ター部110とが形成された1C基板から構成さ これている。

この焦点検出基板106上の大小2つの西菜 ピッチの異なる光電素子アレイ107、109は、 被写体上でなるべく近接した所を見るように配置 されていることが好ましいので、光雷去子アレイ 従ってシフトレジスタ108、110は光電素子 アレイの外側に配置されている。

次に、第4 関を用いて、この焦点検出基板10 6の光質素子アレイについて詳しく説明する。

この光質素子アレイ107(109)の画姿 ピッチは、摄影レンズ101の焦点面(視野紋り 103の面と共役)である一次像面換算でのピッ チから求めることができ、二次像面すなわち焦点 検出基板106上での画素ピッチは一次像面換算 でのピッチに再結像光学系105a、bの倍率M (0,1~1程度)を乗じることで算出できる。 例えば、35mmカメラとして充分放細なパター

ンにまで焦点検出が可能である為にはフィルム面 すなわち焦点面 (一次像面) 換算でのサンブル ピッチが少なくとも100μより細かいことが必 要であり、50 μ程度であれば充分であることが 実験的に分かっている。ここで、サンブルピッチ とは、画像処理に用いるデータ採取点の空間的な 間隔を指すものであり、この第一実施例ではこの サンブルピッチと画素ピッチとは同一であるが、 後述する一部実施例では、サンブルピッチと西索 ピッチとが異なるものもある。従って、西素ピッ チの小さい光位楽子アレイ107の一次像面換算 でのサンプルピッチP。としては、50μ程度以 上100μ程度以下であることが好ましく、光電 素子アレイ107の実際の基板上での百案ピッチ は前記倍率Mを用いて、M・P。 (50μ≤P: ≤ 1 0 0 μ) とする。また、西素ピッチの大きい 光電素子アレイ109の一次像面換算でのサンブ ルピッチP。 としては、100#程度以上である ことが好ましく、例えば、光電業子アレイの実際 の基板上での画素ピッチはM・Pょ (100μ≤

ていることからすると、被写体の暗い場合などは 従来装置では電荷蓄積時間が長くなり応答性を選 化させていたのに対して、本実施例では従来装置 で電荷蓄積時間に 4 0 0 msec かかった時でも大 きい 西素の光電素子アレイ 1 0 9 によれば 1 0 0 msec の蓄積時間で済み、大幅な高速化を達成で きる。

第1図の構成を第3図のフローチャート図に基 づき説明する。

ステップS1にて、インタフェイス部111からの蓄積開始信号を受けて焦点検出基板106の4つの光電素子アレイ部は同時に蓄積を開始する。この光電素子アレイ部の蓄積時間の制御は、公知の方法すなわち特開昭56-154880に開示されているように、受光部で発生した電荷を蓄える蓄積電板の電位を、蓄積開始と同時に所定値にリッセトした後にフローティングとし、露光量に応じて変化するこの蓄積電極の電位をモニター信号となったことを検出し、このモニター信号が所定値となったことを検出して蓄積を終了させる。

P. ×300μ) とすることが好ましい。

関に、 画素ピッチを変えるだけでなく、光電素 子アレイの並び方向と直角方向の幅についても、 サンプルピッチの大きいものは、大きくした方が 好ましく、この幅はサンブルピッチの4~5倍程 度が最適であり、これはサンブルピッチに対して 該幅が小さいとエネルギー的に損であり、逆に該 幅が大きすぎるとサンブルピッチが細かくても該 幅方向で情報が相殺されてサンブルピッチの細か い情報がとれなくなるからである。

そこで、一次像面換算での光電素子アレイ10 7の両素面積をSsとし、また一次像面換算での 光電素子アレイ109の画素面積をScとし、

サンブルビッチの比… P:: P:=1:2 画素面積の比 … S:: S:=1:4 の場合を考える。

大きい方の西素面積が小さい方向の酸素面積の 4 倍なので、同一の信号電荷量を蓄積するのに 4 分の1 の時間ですむことになり、従来の焦点検出 装置が小さい方の光電素子アレイのみで構成され

前記第一面像出力と前記第二面像出力の転送開始タイミングがどのようであっても問題が生じないようにするために、本実施例では第2図に示すように第一面像出力の発生タイミングと第二面像出力の発生タイミングとが基準となるクロック信号に関して1/2位相ずれるような構成をとる。

第2図(A)では、被写体が明るく、光電索子アレイ107。109の電荷蓄積時間が転送クロック周期以下の時の第二面像出力と第一面像出力との発生タイミイングを示し、また第2図(B)では、被写体が少し暗く、第二面像出力の転送中に第一面像出力が転送開始となる際の転送のタイミイングを示し、また第2図(C)では、被写体が暗く、第二面像出力の転送終了後に第一面像出力の転送が開示される場合の転送のタイミングを示して、第2図(A)~(C)中の〇印はA/D変換のタイミングで蓄積が終了して転送が開始されても、A/D変換のタイミングは重なることがないので問題は生じない。

こうして、ステップS3,S5にて、各光電素 子アレイ107,109は、それぞれ被写体像の 画像信号を時系列的にインタフェイス111に送 り、そこでA/D変換して各画素に関する出力値 をメモリ部112に記憶する。

インタフェイス111でA/D変換された第一

図(C)のように粗いサンプルピッチの光電素子 アレイ109の第二百隻出力に基づく第二デフ ォーカス豊算出手段114の演算処理が開始され た後に、細かいサンブルピッチの光電素子アレイ 107の電荷蓄積が終了して第一面像出力の転送 が開始された場合には、第一面復出力の転送、メ モリ部112への記憶を割り込み処理として優先 させて処理している。また、第2図 (A) 及び第 2図(B)のように第二西像出力の後直ぐに第一 画像出力が発生する場合には、焦点検出基板10 6からインタフェース部111へ第一画像出力を 出力するタイミングと第二面像出力を出力するタ イミングを半周期ずらしていることから、第一画 像出力の転送、メモリ部112への記憶と、第二 画像出力の転送、メモリ部112への記憶とが交 互に行われることになる。いずれにしても、ス テップS6において第二面像出力に関して、第二 デフォーカス量と第二情報量とが貸出される。

ステップS7にて、上記第二情報量を所定値と 比較して所定値を満たさない時には低鮮明(低コ 画像出力及び第二画像出力は、メモリ部112に記憶されると、夫々、第一画像出力に基づき、第一デフォーカス量算出手段113により第一デフォーカス量算出手段114により第二デフォーカス量算出手段114により第二デフォーカス量及び第二情報量が算出されることになる。この情報量とは、デフォーカス量算出に用いた画像出力データのコントラスト又はコントラストに関連した量であり、これが所定値より大きければ算出したデフォーカス量に信頼性があることを示す(例えば、特別昭60-151607のパラメータE)。

ステップS2〜S6にて、この第一画像出力と 第二画像出力の転送、メモリ部112への記位は、 第2図に示されるように同時とはならず、舊稿時 間の短い第二画像出力が常に先行する。そして、 第二画像出力のメモリ部112への格納後に、直 ちに第二画像出力に関してデフォーカス量及び情 報量の算出が行われるが、この演算中に、第一画 像出力の転送が開始された場合、異体的には第2

ントラスト)の被写体となり、ステップS11に 遠む。低鮮明の場合は、デフォーカス量が非常に 大きくて被写体像が完全にぼけている場合の他に、 合焦近傍ではあるが被写体パターンが細か過ぎて 第二画像出力データからは検出できない場合を含 んでおり、細かいサンプルピッチの第一画像出力 データを用いる為にステップS11に進む。

また、ステップS7にて、低鮮明でない場合には、ステップS8にて、第二デフォーカス量の総対値と所定値をの大小を比較する。ここで、所定値をは、一次像面換算で3mm程度以下の値である。デフォーカス量が3mm以上になって被写体像のはけが小さい方のサンプルピッチで検出しても得られる情報の空間周波数の上限は同じになってしまい、小 苦積時間の増大や演算時間の増大といったをいかなる。ステップS9では、第二デフォーカス要がなる。ステップS9では、第二デフォーカス量が

おより大きい場合には、とにかく撮影レンズ101を駆動すべくモータ118を制御する。

尚、所定値 & の最適値としては、一回のデフォーカス量検出と駆動制御で確実にデフォーカス量誤差が±50 μ以内に停止されられる範囲を考えれば、150 μ≤ δ≤1 mm程度の値とするのが良い。これは、高速化の為に第一デフォーカス量に基づく駆動制御を最終の1回のみにしようとする観点に基づくものである。

ステップ S 8 にて、第二デフォーカス量 S 8 の場合には、合焦近傍であるので、より構度の高い 焦点検出をする為に、ステップ S 1 1 に進む。

ステップS11にて、被写体が暗い場合には未 だ第一画像出力データが転送されていないので、 第一画像出力データの転送が終了してメモリ部1 12に記憶されるのを待つ。

ステップS12にて、第一画像出力データに基づき、第一デフォーカス量算出手段113により 第一デフォーカス量及び第一情報量が算出される。 判定、制御手段115はステップS13にて、

モータ118で駆動し、合無調節状態を示す表示 部117を制御する。

また、ステップS 9. S 1 4 に続くステップS 1 0 では、再度焦点検出を行う為に、光電素子アレイの受光部をリセットして、ステップS 1 の電荷蓄積に移る。ここで受光部のリセットとは、例えば第一面像出力データに関して蓄積中だとしても、蓄積動作を直ちに中止し、蓄積電荷をクリアにする事である。

このような構成なので、撮影レンズが合焦近傍に近づいた最後の一回の焦点検出を除き、過常、蓄積時間の短い光電素子アレイ109の西像出力のみ用いてデフォーカス量算出演算を疑り返すので、従来の焦点検出装置より蓄積、演算のサイクルタイムが例えば4分の1になり、焦点検出の高速化が速成されると共に、スキャン動作中に像を捕らえる確率も高くなり、また動体追従性も向上する。

次に、焦点検出動作を上記のように、光電素子 アレイ107と光電素子アレイ109との出力 第一情報量及び第二情報量を、それぞれ第一所定 値及び第二所定値と比較し、両方とも所定値に満 たない場合には低鮮明と判定され、ステップ S 1 4 にて、再度、撮影レンズの位置を変えて焦点検 出を行う為にスキャン駆動を行う。また、少なく とも何れか一方の情報量が所定値を越えていれば、 対応するデフォーカス量を用いて、ステップ S 1 5 にて、撮影レンズ 1 0 1 の駆動を行う。

また、両方の情報量が所定値を越えれば、基本的にはサンプルピッチが細かい光電素子アレイ107の第一面像出力に基づく方が検出精度が高いと予想されるので、第一デフォーカス量をレンズ駆動に用いるのが良いが、第一デフォーカス量と第二デフォーカス量との平均や、情報量で重み付けした平均をデフォーカス量として算出し、これにより、ステップS15でレンズ駆動を行うようにしてもよい。

ステップ S 1 5 , S 1 6 にて、判定・制御手段 1 1 5 は決定されたデフォーカス量に基づき、駆動・表示部 1 1 6 を制御して摄影レンズ 1 0 1 を

データを使い分けて、高精度の焦点検出を行う焦点検出装置の他に、外部スイッチ等により焦点検出の高速モードと高精度モードとの切換えを行う 焦点検出装置について説明する。

この無点検出装置は、高精度モードでは前述した第3図のフローチャートに従い処理するものであり、また高速モードでは、基本的には粗いサンプルピッチの光電変換アレイ109のみを使用して、レンズ駆動を行うものであり、例えば第3図のフローチャートに従えばステップS8にてデフォーカス量の絶対値が所定値をより小さくてもステップS11には進まずに、ステップS15に進み処理すれば良い。この高速モードは、特に、移動するような被写体の焦点検出に有効である。

以上のように第一実施例によれば、デフォーカス量が大きい時には、サンブルピッチが大きく、 蓄積時間の短い光電素子アレイを用い、またデフォーカス量が小さい時及び微糊パターンの被写体の場合には、サンブルピッチの小さい光電素子アレイを用い、これら両光電素子アレイを使い分 けているので、焦点検出の応答性に優れ、微細パターンの検出も可能な高精度な焦点検出装置が得られる。また、光電素子アレイの画素面積の大きい方の画像出力は、同一照度なら蓄積時間が短くでき応答性に優れるが、蓄積時間を同一とすればより暗い被写体まで検出が可能となる。即ち、非常に低輝度の時でも画素面積の大きい方の光電素子アレイでは、面積比分だけ情報を多く蓄積できるので、低輝度検出の限界を下げることができ、低輝度の被写体にも充分対応できる焦点検出装置を得ることができる効果がある。

#### - 第二実施例 -

第5図は、第二実施例である焦点検出装置の焦点検出装板106の正面図を示している。

第5図において、サンブルピッチの細かい光電 若子アレイ507 (第一光電素子アレイ部507 a及び第二光電素子アレイ部507b) と、サン ブルピッチの粗い光電素子アレイ509 (第三光 電素子アレイ部509a及び第四光電素子アレイ

電索子アレイ部507bは、それぞれ第三光電索子アレイ部509a及び第四光電索子アレイ部5 09bの中央付近に配置されている。

以上のように、第二実施例では、限られたメモリ領域に記憶されるデータの量を一定とした時に、 その利用効率を高める為に、粗いサンブルピッチ のアレイ部を長くし、細かいサンブルピッチのア レイ部を短くしている。

#### - 第三実施例 -

第6図は、本発明の第三実施例であり、焦点検 出装置の焦点検出基板の正面図を示す。

第6図において、光電素子アレイ607(第一 光電素子アレイ部6.07a及び第二光電素子アレイ部607b)と、光電素子アレイ609(第三 光電素子アレイ部609a及び第四光電素子アレイ部609b)との間に、わずかな空隙をあけて図のごとく並列的に配置し、一方のアレイ部607aと609aとの間にモニタ用画素部612が配置され、また他方のアレイ部607bと609 郎509b) とは、第一実施例の光電素子アレイ 107と109との配置と同様であり、またシフトレジスタ部508,510の配置も第一実施例 と同様である。

光電素子アレイの西素数が増すと、それだけ演算時間が増加するので、サンブルピッチの細かい方の光電素子アレイはアレイ部の長さを短くしてあり、光電素子アレイ507のアレイ部の長さは、一次像面換算で長さし。(2.5~4mm程度)とし、またサンブルピッチの粗い方の光電素子アレイ509のアレイ部の長さは、一次像面換算で長さし。(4mm以上)とすることが望ましい。すなわち、サンブルピッチの細かい光電素子アレイは、合焦近傍のみを判定すればよいので、像ずれ量を算出する範囲も小さくですむため長さし。が小さくてよい。また、サンブルピッチの担い光電素子アレイは、できるだけ像ずれ量の算出範囲を広くとる方が前後ピンの判定域が広がり有利なので、長さし、をできるだけ大きくとる。

この第一光電素子アレイ部507a及び第二光

bとの間に並列的に色温度識別用センサ611a,611 b が配置されている。この例では第一実施例と異なり、モニタ部612を別に設けている。また、シフトレジスタ部608,610は、それぞれ光電素子アレイ607,609の外側に配置されている。

このモニタ用画素部612は、一画素のみで平均光量をモニタするか、あるいは実施例のように複数の画素としてその中の最大値を取ってモニタ出力としている。また、色温度識別用センサ611a.611bは、極近とすることにより、実質的に対数性の50倍程度とすることにより、実質的に対すかに異なる部位を見ていることの影響を軽減している。この色温度識別用センサ611a.611bは、両者の波長分光感度を変える為に、一方の上部にあって中クエルの深さを変えている。このように、波長分光感度の異なるセンサ611a.611bの出力を用いて色収差を補正する。この

色温度識別用センサ 6 1 1 a. 6 1 1 b の出力は 光電素子アレイのシフトレジスタ部 6 0 8 へ画像 出力の転送に合わせて出力するようするのが出力 端子の増加を招かず効率的である。

# - 第四実施例 -

第7図(A)~第8図は、本発明の第四実施例であり、第7図(A)は焦点検出基板の正面図を示し、第7図(B)及び第7図(C)は説明の都合上、簡単化した焦点検出基板上の色温度識別用センサの断面図を示し、第7図(D)は色温度識別用センサの分光感度分布図を示し、第8図は第7図(A)の改良型の焦点検出基板の正面図を示している。

色温度識別を行うためには実質的に被写体の同一部分を分光感度を変えて検出することが必要であり、その為の手段として、分光感度を変えて被写体の略同一部分の出力、さらに好ましくはコントラストを比較する。コントラストを比較するには複数の西素が必要であり、色温度識別用に焦点

のようにPウエルの深さを変えることにより透過 させる波長域を変化させることができる。

この色温度識別用アレイ部712a,712b
の出力から夫々コントラストを算出し、両者の比をとることにより検出光に含まれる赤外光の多寡を知り、撮影レンズの赤外収差量のデータをボディ側で読み取って、赤外光成分の多寡と赤外収差量の大きさに応じて算出したデフォーカス量に補正を行うことができる。

第8図では、第一及び第二光電素子アレイ部807a,807bのそれぞれの両端に、2対の色温度識別用アレイ部812a,812b及び、813a,813bを設けた。このようにすれば、片側の色温度識別用アレイ部の出力がほとんど検出できない時でも、反対側の色温度識別用アレイ部の出力から検出できる確率を高くできる。そしてアレイ部812b,813bに対して、前述と同様に波長分布感度が他のアレイ部と異なるように処理している。

また、例えば、第9囚に示すように、焦点検出

検出用とは別に一対の画案列が必要となり、そのような構成を簡単な構成で達成する例が第7図 (A)及び第8図である。

第一及び第二光電素子アレイ部707a(807a),707b(807b)の画素のうち焦点 検出に用いるのは、第二実施例で述べたように中央部だけで良いので、色温度検出用の画素として、中央部以外の画側の画案列を使用する。

第7図(A)では、第一及び第二光電素子アレイ部707a、707bの一方の端に続いて、複数の画素から成る色温度識別用のアレイ部712a、712bを設けている。ここで、点線で囲んだアレイ部712bには、アレイ部712aと分光密度特性を変える為に、色フィルターを設けるか、あるいはPウエルの深さを変えるかしている。

第7図(B)がPウェルL1の扱い場合を示し、また、第7図(C)がPウェルL2の深い場合を示している。第7図(D)に示すように、扱いPウェルL1の分光分布は実線Tで表され、また深いPウェルL2の分光分布は実線Sで表され、こ

基版 8 0 6 に光電素子アレイ 8 0 7 のみ形成した 焦点検出装置の構成、作用を説明する。すなわち、 第一及び第二光電索子アレイ部8072、807 bには、それぞれ色温度識別用アレイ部812a. 812b及び813a、813bが形成され、点 線で囲まれたアレイ郎812b、813bには前 述したように波長分布感度を変えるための構成が 施されている。この第一光電素子アレイ部807 aの全域(色温度識別用アレイ部 8 1 2 a, 8 l 3 a を含む) は同じ波長分布感度を有している。 この場合、公知の像ずれ検出による焦点検出演算 処理の為の相関演算処理は、一対の光電素子アレ イ部の比較領域を、アレイ部8076の中央部 (イ) に対してアレイ部8072の全域(ロ)~ (ハ) とし、この中央部(イ)に対して全域( ロ)~(ハ)の範囲で画素をずらして行う。特別 昭62-86318では焦点検出用のアレイ部とは全く別 に色温度識別用のアレイ部を並列して配置する方 法が開示されているが、この方法では色温度識別 用のアレイはこの目的にしか利用できず、アレイ

の利用効率が悪い。しかし本実施例では、色温度 識別用アレイ部 8 1 2 a 。 8 1 3 a からの画素出 力データを、色温度識別用としてのみ使用するの ではなく、焦点検出のずれ検出のシフト範囲とし て使用するものであり、限られたデータを多目的 に利用できる効果がある。実際に、カメラ等に内 蔵されたRAMエリアは、かなり容量が少ないの で、データが多目的に使用できることはRAMエ リアの節約となり非常に有効である。

以上のように、第四実施例では、焦点検出用の 光電素子アレイ部の端に、色温度識別用のアレイ 部を設けるので、別段、特別な色温度識別用のア レイ部を形成することなく、簡単の構成で焦点検 出精度を損なうことなく、色温度の識別が可能で ある。

### - 第五実施例 -

第10回及び第11回は、本発明の第五実施例であり、焦点検出基板の正面図を示す。

一般に有限のピッチでサンプルして焦点検出を

る。この欠点を解決したのが、前記②の方法を適用した第10回及び前記③の方法を適用した第11回の実施例である。

第10図では、粗いサンブルピッチの光電素子アレイ909(第一光電素子アレイ郎909a,第二光電素子アレイ郎909b)の西素が図の知く1両素~2西素幅程度傾けて配列されている。被写体パターンYのように、非常に細かい縦線が焦点検出基板906に投影された時には、必ず2西素以上にまたがって投影されるので、この縦線が西素の幅より微少量移動しても西像出力が変化して検出可能となる。

また、第11図では、粗いサンブルピッチの光電素子アレイ1009(第一光電素子アレイ部1 009a及び第二光電素子アレイ部1009b)の西素は、西素ピッチ自体が例えばサンブルピッチの半分、すなわち細かいサンブルピッチの光電素子アレイ1009では、粗いサンブルピッチに関するナイキスト周波数以上の

行うと、サンプルピッチから決まるナイキスト周 波数以上の空間周波数を含む光像に対しては誤っ た焦点検出を行ってしまうことがある。その為に、 有限のピッチでサンブルする場合には、前記ナイ キスト国波数以上の成分が含まれないように何ら かの処理が必要である。その方法としては、①光 学系でナイキスト周波数成分以上の成分がなくな るまでボカす方法、②素子を傾けてナイキスト周 波数成分以上を相殺する方法(アレイ配列と直角 方向に一様な構造をもつパターンに対してのみ有 効だが、カメラの被写体にはこのような構造物が 多い)、③加重加宜フィルターを用い日つ精満な サンブルピッチをとる方法等が知られている。 しかしながら、①の光学系によるボケの利用は一 香簡単に実施しやすいが、西索ピッチの異なる列 が二列あるので、それぞれ最適なポケ量が異なっ てくる。そのために、担いサンブルピッチに介す るナイキスト間波数以上を除去するまでボカルで しまうと、細かいサンブルビッチの光電素子アレ イでは微糊パターンの検出が不能となる欠点があ

成分を除いた画像出力を得る為に、シフトレジス タ1010の最後に設けた電気的な加重加算フィルター1011で処理している。

この加重加算フィルター1011を第12図 (A)~(C) に基づき説明する。第12図 (A) に示すように、シフトレジスタ1010から出力される個々のデータD1~D5は、第12図 (B) で示す重み係数 ω1~ω5に従ってそれぞれ加重加算され、その結果、一つのデータとして出力信号1。が得られる。この出力信号1。が、第12図 (C) の如く順次、出力され、その出力信号」。を出力に相当)してインターフェイス部111に出力されることになる。

従って、サンブルピッチの異なる複数列の光電素子アレイすなわち、光電素子アレイ1007及び1009を使用する場合に、サンブルピッチを必ずしも削述した実施例の如く両素ピッチと同等に構成する必要はなく、光電素子アレイの画素ピッチが1007と1009とで同じでも、加重

加算フィルターを用いてサンプルピッチを異なら してもよい。

#### (発明の効果)

以上のうように本発明によれば、サンブルビッチの細かい第一及び第二光電素子アレイ部と、サンブルビッチの担い第三及び第四光電素子アレイ部とを構成したので、微細なパターンの検出も可能であると共に、応答性及び低輝度限界性能を向上させる効果を奏する。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図~第4図は、本発明の第一実施例であり、 第1図はカメラに適用した焦点検出装置の概念図、 第2図は前記焦点検出装置の第一及び第二デフ ォーカス量算出手段の出力タイミングを示すタイ ミングチャート図、第3図は前記焦点検出装置の フローチャート図、第4図は前記焦点検出装置の 焦点検出装板の構成図を示す。

第5図は、本発明の第二実施例である焦点検出

装置の焦点検出基板106の正面図を示す。

第6図は、本発明の第三実施例であり、焦点検 出装置の焦点検出基板の正面図を示す。

第7図(A)~第9図は、本発明の第四実施例であり、第7図(A)は焦点検出基板の正面図を示し、第7図(B)及び第7図(C)は説明の都合上、簡単化した焦点検出基板上の色温度識別用センサの断面図を示し、第7図(D)は色温度識別用センサの分光感度分布図を示し、第8図は第7図(A)の改良型の焦点検出基板の正面図を示し、第9図は焦点検出基板に一つの光電素子アレイを形成した時の正面図を示す。

第10図~第12図(C)は、木発明の第五実施例であり、第10図及び第11図は焦点検出基板の正面図を示し、第12図(A)~第12図(C)は前配焦点検出基板の加重加算フィルターの説明図を示す。

第13回は、従来の焦点検出装置の概念図を示す。

#### (主要部分の符号の説明)

101…撮影レンズ、103…視野紋り、

106,506,606,706,806.90 6.1006…焦点换出签板、

0, 1 0 0 0 m/m/m/42 til 28 02 1

107a, 507a, 607a, 707a, 90

7 a、1007a…第一光電素子アレイ部

107ь, 507ь, 607ь, 707ь. 90

7 b, 1 0 0 7 b…第二光電索子アレイ部

109a, 509a, 609a, 709a, 90

9 a. 1009 a …第三光電素子アレイ部

1096, 5096, 6096, 7096, 90

9 b, 1 0 0 9 b …第四光電素子アレイ部

108.110.508,510,608.61

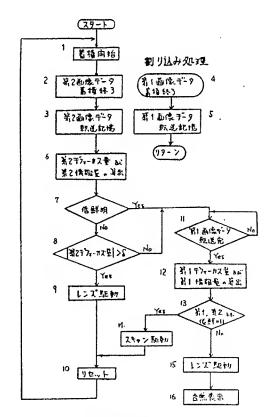
0.708,710,908,910.1008.

1010…シフトレジスタ部

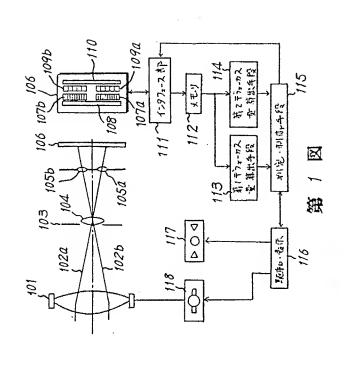
611a, 611b, 712a, 712b, 81

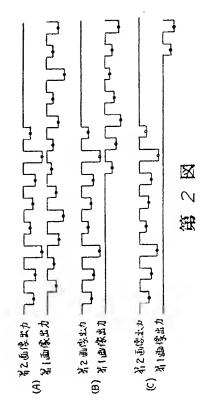
2 a. 8 1 2 b…色温度識別センサ

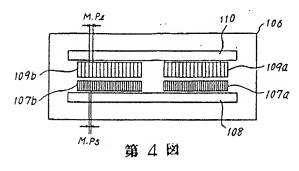
6 1 2 …モニタ用センサ

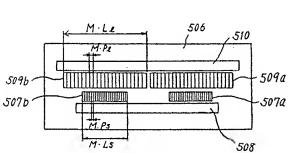


第 ラ 図

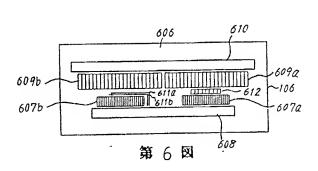


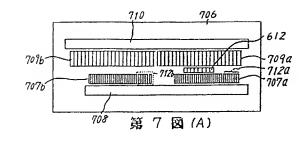


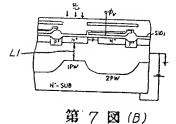




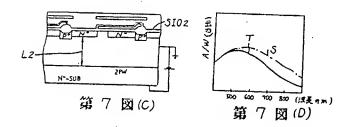
第5図

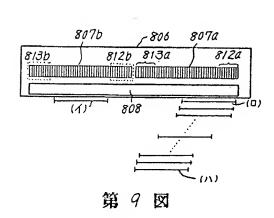


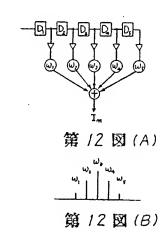


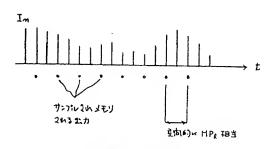


810 809b 807b 807b 第88 第8图

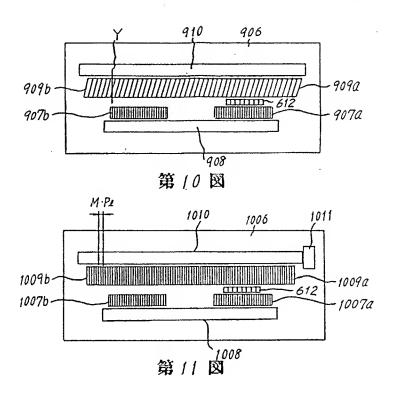


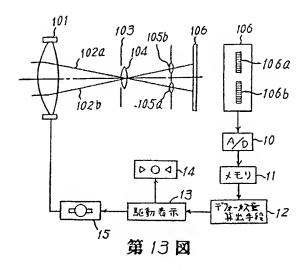






第 12 図(C)





第1]									
砂発	明	者	石	月		譲	刮	東京都品川区西大井1丁目6番3号	日本光学工業株式会
								社大井製作所内	
②発	明	者	長	谷	Ш		洋	東京都品川区西大井1丁目6番3号	日本光学工業株式会
								社大井製作所内	
⑫発	明	者	小	笠	原		昭	東京都品川区西大井1丁目6番3号	日本光学工業株式会
								社大井製作所内	